



Nanotechnology Hub
KYOTO UNIVERSITY

静電容量型加速度センサーの 設計から試作・評価

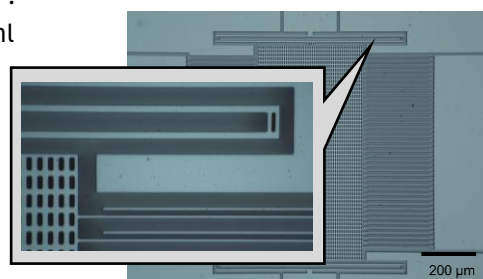
微細加工技術を利用してMEMSデバイスを試作したい異分野の研究者、またセンサーデバイスの応用研究に新規参入したい研究者・技術者向けにチュートリアル的なセミナー（講義・実習）を開催します。奮ってご参加ください。

日程：2024年4月5日(金) 【オンライン】
16日(火)～19日(金) 【実習】

場所：京都大学吉田キャンパス ナノテクノロジーハブ拠点
※交通アクセスについては下記URLをご確認ください。
<http://www.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/access.html>

費用：¥40,000（税込）

※本学都合上、セミナー費用として請求できません。
弊所の利用料金として請求させていただきます。
（請求時期：5月中旬頃／支払期限：6月末）
上記支払方法に不都合ありましたら、ご相談ください。

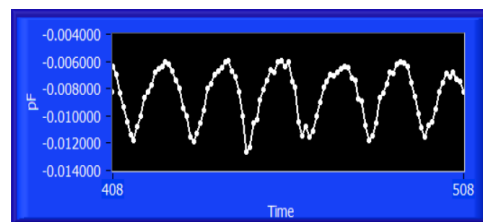


デバイス例

スケジュール：

- 4/5 加速度センサーの設計（座学・実習）※オンライン
- 4/16 フォトマスク設計・有限要素解析
- 4/17 リソグラフィ・Si深堀エッチング（DRIE）
- 4/18 犠牲層エッチング・ダイシング
- 4/19 ボンディング・評価

※進捗状況によっては内容を変更する場合があります。



静電容量変化

お問合せ先：

京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点（担当 佐藤）

E-mail: kyodai-hub@saci.kyoto-u.ac.jp

Tel.: 075-753-5231